PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-293965

(43)Date of publication of application: 09.10.2002

(51)Int.CI.

C08J 7/02 B32B 15/08 C08J 7/04 // CO8L 79:08

(21)Application number: 2001-096253

(71)Applicant: UBE IND LTD

(22)Date of filing:

29.03.2001

(72)Inventor: KATSUKI SHOZO

ABU TOSHIHIKO

NAKAYAMA OSAMU YAMAGUCHI HIROAKI

(54) METHOD FOR TREATING SURFACE AND POLYIMIDE FILM HAVING METAL THIN FILM (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for treating the surface of a polyimide film by which lowering of peel strength is slight even after a metal thin film is formed on the surface of the biphenyltetracarboxylic acid polyimide film and is placed under a high temperature or high humidity, and to provide the polyimide film having the metal thin film.

SOLUTION: The method consists of treating the surface of the polyimide film having a biphenyltetracarboxylic acid component with a solution containing potassium permanganate and/or sodium permanganate and potassium hydroxide and/or sodium hydroxide, and then treating the resultant surface with an acid and thereby improving the adhesive strength to a metal.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-293965 (P2002-293965A)

最終頁に続く

(43)公開日 平成14年10月9日(2002.10.9)

(51) Int.CL'	說別記号	FΙ	デーマコート*(参考)	
C08J 7/02	CFG	C 0 8 J 7/02	CFGB 4F006	
B 3 2 B 15/08		B 3 2 B 15/08	R 4F073	
C08J 7/04	CFG	C08J 7/04	CFGZ 4F100	
# C08L 79:08		C 0 8 L 79:08		
		審查請求 未請求	請求項の数6 OL (全 9 頁)	
(21)出願番号	特願2001-96253(P2001-96253)			
4			金株式会社	
(22)出顧日	平成13年3月29日(2001.3.29)		字部市大字小串1978番地の96	
		(72)発明者 勝木		
			字部市大字小串1978番地の10 字部	
			式会社宇部ケミカル工場内	
		(72)発明者 阿武		
		山口渠:	字部市大字小串1978番地の10 字部	
		興産株:	式会社宇部ケミカル工場内	
		(72)発明者 中山 (\$	
		東京都	東京都港区芝浦一丁目2番1号シーパンス	
		N館 :	宇部興産株式会社東京本社内	

(54) 【発明の名称】 表面処理方法および金属薄膜を有するポリイミドフィルム

(57)【要約】

【課題】 ビフェニルテトラカルボン酸系のポリイミドフィルム表面に金属薄膜を形成した金属薄膜積層ポリイミドフィルムを加熱条件下あるいは加湿条件下に置いた後でも剥離強度の低下が少ないポリイミドフィルムの表面処理方法、および金属薄膜を有するポリイミドフィルムを提供する。

【解決手段】 ピフェニルテトラカルボン酸成分を有するポリイミドフィルムの表面を過マンガン酸カリウムおよび/または過マンガン酸ナトリウムと水酸化カリウムおよび/または水酸化ナトリウムとを含む溶液で処理した後、酸処理することによって金属との接着力を改善する表面処理方法。

20

【特許請求の範囲】

【請求項1】ピフェニルテトラカルボン酸成分を有する ポリイミドフィルムの表面を過マンガン酸カリウムおよ び/または過マンガン酸ナトリウムと水酸化カリウムお よび/または水酸化ナトリウムとを含む溶液で浸漬処理 した後、酸処理することによって金属との接着力を改善 することを特徴とする表面処理方法。

【請求項2】浸漬処理が、過マンガン酸カリウムおよび /または過マンガン酸ナトリウムを10~100g/L の濃度で含みかつ水酸化カリウムおよび/または水酸化 10 ナトリウムを10~100g/Lの濃度で含み20~8 5℃の水溶液に10~600秒間程度浸析して行われる 請求項1または2に記載の表面処理方法。

【請求項3】酸処理した後、さらに表面をプラズマ処理 する請求項1に記載の表面処理方法。

【請求項4】ポリイミドフィルムが、ピフェニルテトラ カルボン酸系の高耐熱性ポリイミド層の片面または両面 にビフェニルテトラカルボン酸系熱可塑性ポリイミド層 が積層された多層ポリイミドフィルムである請求項1~ 3のいずれかに記載の表面処理方法。

【請求項5】請求項1~4のいずれかに記載の表面処理 方法によって金属との接着力を改善したポリイミドフィ ルムに、蒸着法もしくは蒸着法とメッキ法との組み合わ せによって金属膜を形成してなる金属薄膜を有するポリ イミドフィルム。

【請求項6】蒸着法によって設けられる第一蒸着層金属 が、ニッケル、クロム、コバルト、パラジウム、モリブ デン、タングステン、チタン、ジルコニウムのいずれか で厚みが1~30nmであり、第二金属層が蒸着法もし くは蒸着法とメッキ法によって設けられる金属がニッケ 30 ル、コバルト、またはこれらの合金、銅のいずれかで、 厚みが0.1~2.0μmであり、さらにメッキ法によ る最外層が厚みが0~30 µmの銅層である請求項4に 記載の金属薄膜を有するポリイミドフィルム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、ポリイミドフィ ルムの表面処理方法の改良および金属薄膜を有するポリ イミドフィルムに関するものであり、さらに詳しくはポ リイミドフィルム表面に金属薄膜を形成した金属薄膜積 40 層ポリイミドフィルムの剥離強度を改善するとともに加 熱条件下あるいは加湿条件下に置いた後でも比較的大き な剥離強度を維持するポリイミドフィルムの表面処理方 法および金属薄膜を有するポリイミドフィルムに関する ものである。

[0002]

【従来の技術】カメラ、パソコン、液晶ディスプレイな どの電子機器類への用途として芳香族ポリイミドフィル ムは広く使用されている。芳香族ポリイミドフィルムを フレキシブルブリント板 (FPC) やテープ・オートメ 50 を加熱条件下あるいは加湿条件下に置いた後でも剥離強

イティッド・ボンディング (TAB) などの基板材料と して使用するためには、エポキシ樹脂などの接着剤を用 いて銅箔を張り合わせる方法が採用されている。

【0003】芳香族ポリイミドフィルムは高耐熱性、機 械的強度、電気的特性などが優れているが、接着剤の高 耐熱性等が劣るため、本来のポリイミドの特性を損なう ことが指摘されている。このような問題を解決するため に、接着剤を使用しないでポリイミドフィルムにニッケ ルやクロムなどの金属を蒸着して銅を電気メッキした り、銅箔にポリアミック酸溶液を塗布し、乾燥、イミド 化したり、熱可塑性ポリイミドで熱圧着させたオールポ リイミド基材が開発されている。しかし、これらオール ポリイミドの銅張板は、接着強度が小さいとか電気特性 が損なわれるという問題点が指摘されている。

【0004】例えば、ポリイミドフィルムと銅層との間 にポリイミド接着剤をサンドイッチ状に接合したポリイ ミドラミネートが知られている(米国特許第45432 95号)。しかし、とのポリイミドラミネートでは、低 熱線膨張のピフェニルテトラカルボン酸系ポリイミドフ ィルムについては接着強度が小さく使用できないという 問題がある。

【0005】とのため、ロールラミネート法で、熱融着 性のポリイミドとして特定の芳香族ジアミンによって得 られたものを使用する方法が提案されている。しかし、 これらの方法によって得られるポリイミド銅張板でも、 加湿条件下に置いた後の剥離強度が小さかったり、金属 層の厚みを小さくすることが不可能な場合があり金属層 の厚みを自由に変えることが困難であった。

【0006】また、メッキ法の改良として、特開平6-21157号が知られている。前記公報によれば、ポリ イミドフィルムの表面を過マンガン酸ナトリウムや過マ ンガン酸カリウムなどの過マンガン酸塩あるいは次亜塩 素酸ナトリウムや次亜塩素酸カリウムなどの次亜塩素酸 塩の水溶液で処理して親水化するポリイミドフィルムの 表面処理方法、及びこの処理面に無電解メッキしてニッ ケルあるいはコバルトの金属薄層を形成し、場合により さらに無電解メッキして銅層を形成した後、電気メッキ して銅層を形成した銅ポリイミド基板は髙温環境下に長 時間放置による密着強度の低下が無視できるとされる。 【0007】しかし、上記の公報に記載されているポリ イミドフィルムはピロメリット酸系のカプトン(東レ・ デュポン社)であり、この発明者らが前記の表面処理方 法をピフェニルテトラカルボン酸系のポリイミドフィル ムに適用したところ、効果がないことが明らかになっ

[0008]

た。

【発明が解決しようとする課題】との発明の目的は、ビ フェニルテトラカルボン酸系のポリイミドフィルム表面 に金属薄膜を形成した金属薄膜積層ポリイミドフィルム

度の低下が少ないポリイミドフィルムの表面処理方法、 および金属薄膜を有するポリイミドフィルムを提供する ことである。

[0009]

【課題を解決するための手段】すなわち、この発明は、 ビフェニルテトラカルボン酸成分を有するポリイミドフ ィルムの表面を過マンガン酸カリウムおよび/または過 マンガン酸ナトリウムと水酸化カリウムおよび/または 水酸化ナトリウムとを含む溶液で浸漬処理した後、酸処 理することによって金属との接着力を改善することを特 10 徴とする表面処理方法に関する。

【0010】また、この発明は、前記の表面処理方法に よって金属との接着力を改善したポリイミドフィルム に、蒸着法もしくは蒸着法とメッキ法との組み合わせに よって金属膜を形成してなる金属薄膜を有するポリイミ ドフィルムに関する。

【0011】 この発明においては、ビフェニルテトラカ ルボン酸成分を有するポリイミドフィルムの表面を過マ ンガン酸カリウムおよび/または過マンガン酸ナトリウ ムと水酸化カリウムおよび/または水酸化ナトリウムと 20 を含む溶液で浸析、吹き付けなどによって処理した後、 酸処理することを組み合わせることが重要であり、これ によってピフェニルテトラカルボン酸成分を有するポリ イミドフィルムであっても、フィルム表面に金属薄膜を 形成した金属薄膜積層ポリイミドフィルムを加熱条件下 あるいは加湿条件下に置いた後の剥離強度の低下を少な くすることが可能となる。

[0012]

【発明の実施の形態】以下にこの発明の好ましい態様を 列記する.

- 1) アルカリ過マンガン酸処理が、過マンガン酸カリウ ムおよび/または過マンガン酸ナトリウムを10~10 0g/Lの濃度と水酸化カリウムおよび/または水酸化 ナトリウムを10~100g/Lの濃度で含み20~8 5℃の水溶液に10~600秒間程度浸析して行われる 前記の表面処理方法。
- 2) さらに表面をプラズマ処理する前記の表面処理方 法。

【0013】3) ポリイミドフィルムが、ピフェニルテ トラカルボン酸系の高耐熱性ポリイミド層の両面にビフ ェニルテトラカルボン酸系熱可塑性ポリイミド層が積層 された多層ポリイミドフィルムである前記の表面処理方 法。

4) 蒸着法によって設けられる第一蒸着層金属が、ニッ ケル、クロム、コバルト、パラジウム、モリブデン、タ ングステン、チタン、ジルコニウムのいずれかで厚みが 1~30 n mであり、第二金属層が蒸着法もしくは蒸着 法とメッキ法によって設けられる金属がニッケル、コバ ルト、またはこれらの合金、Cuのいずれかで、厚みが $0.1 \sim 2.0 \mu m$ であり、さらにメッキ法による最外 50 て、3、3、4、4、-ビフェニルテトラカルボン酸

層が厚みが0~30μmの銅層である前記の金属薄膜を 有するポリイミドフィルム。

【0014】との発明においてはポリイミドフィルムと して、好適には3、3'、4、4'-ビフェニルテトラ カルボン酸二無水物(以下単に s - B P D A と略記する こともある。)と4、4'ージアミノジフェニルエーテ ル (以下単にDADEと略記することもある。)と、場 合によりさらにパラーフェニレンジアミン(以下単にP PDと略記することもある。)、場合によりさらにピロ メリット酸二無水物(以下単にPMDAと略記すること もある。) と3, 3', 4, 4' -ベンゾフェノンテト ラカルボン酸二無水物(BTDA)とから製造される厚 みが5~120μmのs-BPDA-DADE系(s-BPDAおよびDADEを含有することを意味する。) ポリイミドフィルムが挙げられる。

【0015】前記のポリイミドフィルムの物性を損なわ ない範囲で、他の種類の芳香族テトラカルボン酸二無水 物や芳香族ジアミン、例えば4,4.-ジアミノジフェ ニルメタン等を使用してもよい。また、前記の芳香族テ トラカルボン酸二無水物や芳香族ジアミンの芳香環に置 換基、たとえば水酸基、メチル基あるいはメトキシ基な どを導入してもよい。

【0016】特に、この発明におけるピフェニルテトラ カルボン酸系ポリイミドフィルムとして、髙耐熱性ポリ イミド層の両面にTg (ガラス転移温度)が200~3 00℃のピフェニルテトラカルボン酸系熱可塑性ポリイ ミド層が積層された多層ポリイミドフィルムが好適であ る。前記のピフェニルテトラカルボン酸系ポリイミドフ ィルムとしては、ビフェニルテトラカルボン酸系熱可塑 性ポリイミド層の厚みが1~10μmで、高耐熱性ポリ イミド層の厚みが5~120μmであり全体の厚みが7 ~125 µm程度であるビフェニルテトラカルボン酸系 多層ポリイミドフィルムが高いレベルの寸法精度および 剛性を有しており好適である。

【0017】上記の髙耐熱性ポリイミドとしては、単層 のポリイミドフィルムの場合にガラス転移温度が約35 0℃未満程度の温度では確認不可能であるものが好まし く、特に線膨張係数(50~200℃)(MD、TDお よびこれらの平均のいずれも)が5×10⁻⁶~25× 10- 0cm/cm/℃であるものが好ましい。この高 耐熱性ポリイミドは、最終的に得られるポリイミドフィ ルムの線膨張係数およびガラス転移温度が前記の範囲で あれば任意のテトラカルボン酸成分および芳香族ジアミ ンを略1:1となるようにランダム重合、ブロック重 合、ブレンド、あるいはあらかじめ2種類以上のポリア ミック酸溶液を合成しておき各ポリアミック酸溶液を混 合してポリアミック酸の再結合によって共重合体を得 る、いずれの方法によっても得られる。

【0018】その中でも特に、高耐熱性ポリイミドとし

5

二無水物とパラーフェニレンジアミンと場合によりさらに4、4'ージアミノジフェニルエーテルと、場合によりさらにピロメリット酸二無水物(以下単にPMDAと略記することもある。)および/または3、3'、4、4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物(BTDA)とから得られるs-BPDA-PPD系(s-BPDAおよびPPDを含有することを意味する。)ポリイミドフィルムが好適である。

【0019】前記の熱可塑性ポリイミドを与える芳香テトラカルボン酸成分としては、2,3,3',4'-ビ 10フェニルテトラカルボン酸二無水物(以下、a-BPD Aと略記することもある。)および3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物が挙げられ、その一部をピロメリット酸二無水物、3,3',4,4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物などで置き換えてもよい。

【0020】また、熱可塑性ポリイミドを与える芳香族ジアミンとしては、4,4'ージアミノジフェニルエーテル、4,4'ージアミノベンゾフェノン、4,4'ージアミノジフェニルメタン、2,2ービス(4ーアミノフェノキシベンゼン)、1,4ービス(4ーアミノフェノキシ)ベンゼン、4,4'ービス(4ーアミノフェニル)ジフェニルエーテル、4,4'ービス(4ーアミノフェニル)ジフェニルメタン、4,4'ービス(4ーアミノフェニル)ジフェニルメタン、4,4'ービス(4ーアミノフェノキシ)ジフェニルエーテル、4,4'ービス(4ーアミノフェノキシ)ジフェニルメタン、2,2ービス(4ー(アミノフェノキシ)フェニル】プロバンなどの複数のベンゼン環を有する柔軟な芳香族ジアミンを挙げることができる。

【0021】前記芳香族ジアミンの一部を、1,4-ジアミノブタン、1,6-ジアミノヘキサン、1,8-ジアミノオクタン、1,10-ジアミノデカン、1,12-ジアミノドデカンなどの脂肪族ジアミン、ピス(3-アミノプロピル)テトラメチルジシロキサンなどのジアミノジシロキサンによって置き換えてもよい。また、前記の熱可塑性ポリイミドのアミン末端を封止するためにジカルボン酸類、例えば、無水フタル酸およびその置換体、ヘキサヒドロ無水フタル酸およびその置換体、無水コハク酸およびその置換体やそれらの誘導体など、特に、無水フタル酸を使用してもよい。

[0022]前記の各ボリイミドは、前記各成分と、さらに場合により他のテトラカルボン酸二無水物および他のジアミンとを、有機溶媒中、約100℃以下、特に20~60℃の温度で反応させてボリアミック酸の溶液とし、このポリアミック酸の溶液をドープ液として使用できる。この発明におけるボリイミドフィルムを得るためには、前記の有機溶媒中、酸の全モル数(テトラ酸二無水物とジカルボン酸の総モルとして)の使用量がジアミン(モル数として)に対する比として、好ましくは0.

92~1.1、特に0.98~1.1、そのなかでも特

に0.99~1.1であるような割合が好ましい。 [0023]また、ボリアミック酸のゲル化を制限する目的でリン系安定剤、例えば亜リン酸トリフェニル、リン酸トリフェニル等をポリアミック酸重合時に固形分(ポリマー)濃度に対して0.01~1%の範囲で添加することができる。また、イミド化促進の目的で、ドープ液中に塩基性有機化合物系触媒を添加することができる。例えば、イミダゾール、2ーイミダゾール、1.2ージメチルイミダゾール、2ーフェニルイミダゾールなどをポリアミック酸(固形分)に対して0.01~20重量%、特に0.5~10重量%の割合で使用することができる。これらは比較的低温でポリイミドフィルムを形成するため、イミド化が不十分となることを避けるために使用する。

【0024】また、熱可塑性ポリイミド原料ドーブに有機アルミニウム化合物、無機アルミニウム化合物または有機錫化合物を添加してもよい。例えば水酸化アルミニウム、アルミニウムトリアセチルアセトナートなどをポリアミック酸(固形分)に対してアルミニウム金属として1ppm以上、特に1~1000ppmの割合で添加することができる。

【0025】前記のポリアミック酸を得るために使用する有機溶媒は、髙耐熱性ポリイミドおよび熱可塑性ポリイミドのいずれに対しても、N-メチル-2-ピロリドン、N、N-ジメチルホルムアミド、N、N-ジメチルアセトアミド、N、N-ジェチルアセトアミド、N・N-ジェチルスルホキシド、ヘキサメチルホスホルアミド、N-メチルカプロラクタム、クレゾール類などが挙げられる。30 これらの有機溶媒は単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

【0026】前記の多層ポリイミドフィルムの製造においては、好適には共押出し一流延製膜法、例えば上記の高耐熱性ポリイミドのポリアミック酸溶液の片面あるいは両面に熱可塑性ポリイミドまたはその前駆体の溶液を共押出して、これをステンレス鏡面、ベルト面等の支持体面上に流延塗布し、100~200℃で半硬化状態またはそれ以前の乾燥状態とする方法が好適である。この半硬化状態またはそれ以前の状態とは、加熱および/または化学イミド化によって自己支持性の状態にあることを意味する。

【0027】前記高耐熱性ポリイミドを与えるポリアミック酸の溶液と熱可塑性ポリイミドを与えるポリアミック酸の溶液との共押出しは、例えば特開平3-180343号公報(特公平7-102661号公報)に記載の共押出法によって三層の押出し成形用ダイスに供給し、支持体上にキャストしておこなうことができる。

[0028]前記の高耐熱性ポリイミドを与える押出し 物層の片面または両面に、熱可塑性ポリイミドを与える 50 ポリアミック酸溶液を積層して多層フィルム状物を形成

40

して乾燥後、熱可塑性ポリイミドのガラス転移温度以上 で劣化が生じる温度以下の温度、好適には300~50 O°Cの温度(表面温度計で測定した表面温度)まで加熱 して(好適にはこの温度で1~60分間加熱して)乾燥 およびイミド化して、高耐熱性ポリイミド層(基体層) の片面または両面、好適には両面に熱可塑性ポリイミド を有する多層ポリイミドフィルムを製造することができ

【0029】また、前記髙耐熱性ポリイミド層の厚さは 5~120μm、特に5~70μm、その中でも5~4 10 Ομπであることが好ましい。 5μπ未満では作成した 多層ポリイミドフィルムの機械的強度、寸法安定性に問 題が生じる。また120μmより厚くなると溶媒の除 去、イミド化に難点が生じる。また、前記熱可塑性ポリ イミド層の厚みは各々1~10μm、特に2~5μm程 度が好ましい。 1 μ m 未満では接着性能が低下し、10 μmを超えても使用可能であるがとくに効果はなく、む しろポリイミドフィルムの耐熱性が低下する。

【0030】また、多層ポリイミドフィルムは厚みが7 ~125 µm、その中でも7~50 µmであることが好 20 ましい。7μm未満では作成したフィルムの取り扱いが 難しく、125μmより厚くなると溶媒の除去、イミド 化に難点が生じる。前記の共押出し-流延製膜法によれ ば、髙耐熱性ポリイミド層とその片面または両面の熱可 塑性ポリイミドとを強固に積層させることができ、良好 な電気特性および機械特性を有する多層ポリイミドフィ ルムを得ることができる。

【0031】この発明においては、前記のビフェニルテ トラカルボン酸成分を有するポリイミドフィルムの表面 を過マンガン酸カリウムおよび/または過マンガン酸ナ トリウムと水酸化カリウムおよび/または水酸化ナトリ ウムとを含む溶液に浸析などで処理した後、酸処理する ことによって表面処理する。

【0032】前記の浸析処理において、過マンガン酸カ リウムおよび/または過マンガン酸ナトリウムを10~ 100g/Lの濃度と水酸化カリウムおよび/または水 酸化ナトリウムを10~100g/Lの濃度で含み20 ~85℃の水溶液に10~600秒間程度前記ポリイミ ドフィルムを浸析して行うことが好ましい。浸析処理の 前にジエチレングリコールモノブチルエーテル (25 %)とエチレングリコール(10%)と水酸化ナトリウ ム(1~10g/し)との混合水溶液などで表面を膨潤 化する処理を入れてもかまわない。また、前記の浸析処 理はバッチ法でも行うことができるが、連続的に行うこ とが好ましい。

【0033】前記の方法によって浸析処理し、次いで酸 処理してポリイミドフィルム表面を中和する。前記の酸 処理の条件については特に制限はないが、硫酸、塩酸、 硝酸などの無機酸や酢酸、蟻酸などの有機酸、好適には 硫酸で処理し、好適には水洗浄して処理を完了する。前 50 ることが加工安定性と膜の緻密化の観点から好ましい、

記の表面処理に続いて、第一層金属薄膜を形成する直前 に、さらに表面をプラズマ処理することにより、フィル ム表面を清浄化して金属との接着力をさらに改善すると とが好ましい。

【0034】との発明においては、前記の表面処理方法 によって金属との接着力を改善したポリイミドフィルム の表面処理面に、蒸着法または蒸着法と無電解メッキお よび/または電気メッキのメッキ法との組み合わせによ って金属膜を形成して、金属薄膜を有するポリイミドフ ィルムを得ることができる。

【0035】との発明において、前記ポリイミドフィル ムの表面処理面への金属蒸着は、第一蒸着金属層と順次 積層される金属膜からなる第二金属層との2層から形成 してもよい。前記ポリイミドフィルムの表面処理面に蒸 着する第一蒸着金属層を構成する金属としては、ポリイ ミドと他に順次積層される第二蒸着層との密着性を強固 にするもの、熱による拡散がなく、強固であること、薬 品性や耐熱性が良いこと等が重要である。このため、ニ ッケル、クロム、コパルト、パラジウム、モリブデン、 タングステン、チタン、ジルコニウムの群から選択した 1種以上を用いることが好適である。

【0036】前記の場合、第一蒸着金属層の蒸着膜厚 は、1~30nmの範囲が好適である。これらの範囲に おいて接着力の増強および熱負荷後の耐久性を保持する ことが必要である。前記蒸着膜厚が l n m未満では、ポ リイミドフィルムとの密着性が不足し、耐薬品性、耐熱 性も不十分となるため好ましくない。一方、蒸着膜厚が 30nmを越えると、第一蒸着金属層の内部で凝集破壊 を起とし、接着力の低下を引き起とす。またエッチング の効率の面でも好ましくない。

【0037】この発明の表面処理法によれば、フィルム 表面に図1のSEM観察図で示すように多数の凹凸が形 成される。このため、第一蒸着金属層はポリイミドフィ ルム表面処理面(片面または両面)に、フィルムの表面 より内にむけた厚み方向に、蒸着金属がフィルムに混在 するように形成されることが接着力の増強および熱負荷 後の耐久性を保持するのに必要である。ポリイミドフィ ルムの表面から好適には1nm以上、より好ましくは、 2 n m以上の深部より蒸着金属がフィルムに混在するよ うに形成される。この蒸着金属がポリイミドフィルム中 より形成されることによる投錨効果により、形成する蒸 着層が強固なものとなると考えられる。

【0038】第一蒸着金属層は、ポリイミドフィルムの 表面処理面(片面または両面)に好適には加熱蒸着法、 スパッタリング法、イオンプレーティング法、イオンア シスト法で蒸着させて形成する。前記の第一蒸着層金属 の蒸着条件として、蒸着膜を形成する時の真空度は、予 め5×10⁻⁴ Pa以下の高真空とすることが好まし い。スパッタリング法の場合、ガス圧は5Pa以下とす

さらに5×10-1 Pa以下に保持することが好まし い。用いられるガス種はアルゴン、ネオン、クリプト ン、ヘリウム等の稀ガスの他に窒素、水素も採用できる が、アルゴン、窒素が安価でより好ましい。

【0039】蒸着直前にフィルム温度を予め30~28 0℃の範囲に温めることがフィルムに吸着した水分によ る金属膜の酸化防止、膜の緻密化と均一化を高めるため に好ましい。さらに30~120℃とするのがより好ま しい。280℃を越えると加工後に未冷却からくるプロ ッキング、加工中のしわの発生などで好ましくない。と 10 の加熱は加熱ロールや蒸着直前での加熱用ヒーターを用 いてもかまわない。また、加熱後第一層金属薄膜を形成 する直前に、さらに表面をプラズマ処理することによ り、フィルム表面の清浄化を行い金属との接着力をさら に改善することが好ましい。

【0040】前記第一蒸着金属層上に銅の第二蒸着層を 形成する場合、銅の第二蒸着層はスパッタリング法、イ オンプレーティング法、電子ビーム蒸着法等で銅を蒸着 して形成する。銅の第二蒸着層厚は10nm~5μmの 節用が好ましく、100~500nmの範囲がより好ま 20 -2-ピロリドン中でDADEとs-BPDAとを1: しい。蒸着膜厚は10nm未満では、メッキ用の金属下 地層として充分に果たせないので好ましくない。また、 5μmを越えるとコストが上昇するので好ましくない。 【0041】第一蒸着金属層と第二蒸着層の蒸着加工は フィルム走行中に、順次連続しても非連続で実施しても かまわない。たとえば、一旦第一蒸着金属層を施した該 蒸着ポリイミドフィルムを逆方向に搬送して次の第二蒸 着層の蒸着を行ってもかまわない。ただし、第一金属層 を蒸着後に一度真空系を解放してしまうのは、第一金属 層が酸化してしまうため、接着力の点から好ましくな とう。

【0042】前記第二蒸着層を形成する時の真空度は、 予め5×10-1Pa以下の高真空とすることが好まし い。スパッタリング法の場合、ガス圧は5 P a 以下とす ることが加工安定性と膜の緻密化の観点から好ましい。 さらに5×10⁻¹ Pa以下に保持することが好まし い。蒸着時に使用するガス種はアルゴン、ネオン、クリ プトン、ヘリウム等の稀ガスの他に窒素、水素も採用で きるが、アルゴン、窒素が安価で好ましい。

び/または電気メッキからなるメッキ法により、銅メッ キ層を形成して導体層を厚くしてもかまわない。前記銅 メッキ層のメッキ膜厚は0~20μmの範囲が好まし い。20μπを越えると高密度配線においての線幅の精 度が低下することや、部品実装での軽量、小型化の面で 不利となる。またコストも上昇するので好ましくない。 【0044】との発明の金属薄膜を有するポリイミドフ ィルムは、そのままあるいはロール巻き、エッチング、 および場合によりカール戻し等の各処理を行った後、必 て使用できる。例えば、FPC、TAB、多層FPC、 フレックスリジッド基板の基板として好適に使用するこ とができる。

[0045]

【実施例】以下、との発明を実施例によりさらに詳細に 説明する。以下の各例において、金属薄膜を有するポリ イミドフィルムの剥離強度は、銅メッキ後24時間経過 後の未処理、150℃で24時間放置、200℃で24 時間放置、および121℃で2気圧の湿度100%の雰 囲気で24時間放置(PCT24H)、の各々につい て、10mm幅に切り出したサンプルの90°剥離強度 (50mm/分の速度で剥離)を測定した。ポリイミド フィルムの機械的物性は、ASTM D882によって 測定した。

【0046】参考例1

多層ポリイミドフィルムの作成

N-メチル-2-ピロリドン中でPPDとs-BPDA とを1:1のモル比で重合させて得たモノマー濃度が1 8重量%の高耐熱性ポリイミド用ドープと、N-メチル 1モル比で重合させて得たモノマー濃度が18重量%の 熱可塑性ポリイミド製造用ドープとを三層押出し成形用 ダイス (マルチマニホールド型ダイス)を設けた製膜装 置を使用し、金属製支持体上に流延し、150°Cの熱風 で連続的に乾燥し、固化フィルムを形成した。この固化 フィルムを支持体から剥離した後、加熱炉で200℃か **ら525℃まで徐々に昇温して溶媒の除去、イミド化を** 行って、三層押出しポリイミドフィルムを巻き取りロー ルに巻き取って、三層押出しポリイミドフィルムを得 30 た。

【0047】得られた三層押出しポリイミドフィルム は、次のような物性を示した。

厚み構成: 3 μm/44μm/3μm (合計50μm) 熱可塑性ポリイミドは、Tgが275℃であった。 体積抵抗>1×10¹⁵Q·cm

との多層ポリイミドフィルムは、熱線膨張係数(50~ 200℃: MD、TDとも) が10×10 ⁻ 6~20× 10^{- 4}×cm/cm/℃の範囲内であった。

【0048】実施例1

【0043】前記第二蒸着層上には、無電解メッキおよ 40 前記の多層ポリイミドフィルムを次の各工程によって、 順次表面処理した。

1. 処理1

過マンガン酸カリ:60g/Lと水酸化ナトリウム:4 5g/Lの水溶液に1分間浸漬後、水洗し、硫酸:50 mL/Lで中和後、再度水洗を行い、浸漬処理を完了し た。

2. 処理2

スパッタリング装置に処理1で処理したフィルムを基板 フォルダーに設置後、2×10⁴ Pa以下の真空に排 要ならば所定の大きさに切断して、電子部品用基板とし 50 気後、アルゴンを導入し、0.67Paとした後、電極

に13.56MHzの高周波電力500wで1分間プラ ズマ処理により表面のクリーニングを行った。

【0049】得られた表面処理フィルムを、次の工程に よって金属膜形成した。

3. 金属膜形成

前記の工程に連続して、アルゴン0.67Pa雰囲気 下、10 n mのクロム薄膜を形成後、0.4 μ mの銅薄 膜を形成し、大気中に取り出した。さらに、酸性硫酸銅 水溶液の電解メッキ液を用いて、金属膜が20μmとな ドフィルムを得た。評価結果をまとめて表1に示す。

【0050】実施例2、3

処理 1 で、過マンガン酸カリ:6 0g/Lと水酸化ナト リウム: 45g/Lの水溶液に浸漬する時間を3分間 * * (実施例2)、あるいは5分間(実施例3)に変えた他 は実施例1と同様に実施して、ポリイミドフィルムを表 面処理し、金属薄膜を有するポリイミドフィルムを得 た。結果をまとめて表1に示す。

【0051】比較例1

処理1を行わなかった他は実施例1と同様にして、金属 薄膜を有するポリイミドフィルムを得た。初期剥離強度 は0.86kg/cmであったが、150℃、200℃ の各処理および121℃で2気圧の湿度100%の雰囲 るように銅メッキを施して、金属薄膜を有するポリイミ 10 気で24時間放置した後の各サンブルは剥離強度が著し く低下した。結果を表1に示す(処理時間0min)。 [0052]

【表1】

処理時間	刺離強度:kg/cm				
min	初期強度	150℃24H後	200℃24H後	PCT24H後	
0	0.86	0.10	0.12	0.72	
1	1.80	1.25	1.20	1.38	
3	1.65	0.85	0.96	1.09	
5	1.63	0.80	0.84	1.10	

*測定は10mm幅 90degビール

【0053】比較例2

ポリイミドフィルムとして、カプトンH(東レ・デュポ ン社)を使用した他は実施例1と同様にして、、ポリイ ミドフィルムを表面処理した。処理1を行った後、フィ ルム表面の溶解が著しく、次の工程に進めなかった。

[0054]

【発明の効果】との発明によれば、以上のような構成を 有しているため、次のような効果を奏する。

【0055】との発明によれば、ポリイミドフィルム表 面に金属薄膜を形成した金属薄膜を有するポリイミドフ 30 ムのSEM観察図である。

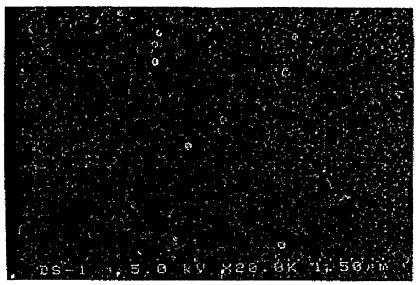
ィルムを加熱条件下または加湿条件下に置いた後でも比 較的大きな剥離強度を維持するポリイミドフィルムが得 られる。また、この発明によれば、加熱条件下または加 湿条件下に置いた後でも比較的大きな剥離強度を維持す る金属薄膜を有するポリイミドフィルムが得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、実施例1において処理1により表面処 理したポリイミドフィルムのSEM観察図である。

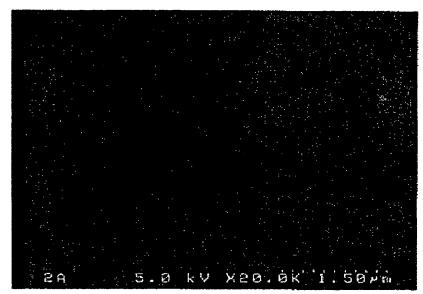
【図2】図2は、比較例1の未処理のポリイミドフィル

【図1】



実施例1 表面 SEM 写真 (処理1終了後)

【図2】



比較例 1 表面 SEM 写真

フロントページの続き

(72)発明者 山口 裕章 東京都港区芝浦一丁目2番1号シーバンス N館 宇部興産株式会社東京本社内 F ターム (参考) 4F006 AA39 AB73 DA01 4F073 AA01 BA31 BB01 CA01 EA01 EA11 EA32 EA33 EA34 EA36 EA53 EA54 4F100 AB01B AB12B AB13B AB15B AB15D AB16B AB16D AB17D AB19B AB20B AB31D AK49A AK49C BA02 BA03 BA04 BA07 BA10A BA13 EH66B EH66D EH71D EJ61A EJ68A GB41 GB43 JA20B JA20D JB16C JJ02A JK06 YY00B

YY00D